

# 國立臺灣大學技術行銷表

台大案號： 06A-101229

產學合作中心聯絡人：蘇祈烈

電話：02-33669949

e-mail：such@ntu.edu.tw

產品/技術名稱	以電子影像掃描訊號偵測多電子束漂移現象的技術
發明人/單位	顏家鈺教授/台灣大學機械系 陳永耀教授/台灣大學電機系 郭逸宏、吳政儒/台灣大學機械系
產品/技術說明	本發明係有關一種具有偵測多電子束漂移現象的感測技術，其主要係由在多電子束裝置組設電子影像感測裝置與在直寫區域先組設一組易於感測的圖案所組成，該感測裝置能接收電子束直寫時所產生的散射電子而能掃描成電子影像；而感測圖案能產生較強的散射電子可在電子影像上有較顯著的成像，藉此，能快速有效率地偵測多電子束隨著時間漂移的現象。
應用範圍	半導體製造
產品/技術優勢	本技術可以應用在任何有電子束的儀器上，例如電子顯微鏡等；在電子束直寫應用上，透過本技術，將可有效偵測電子束漂移並可進一步對電子束進行控制使接合處的圖案得以對準。
市場潛力	本技術可應用在多電子束直寫設備上，其所衍生的投資效益將有直接貢獻。
產品/技術 智財權保護方式	專利申請中
圖片 (已公開之成果可提供圖片)	

## Marketing Abstract of NTU's Invention Disclosure

NTU's docket no: \_\_\_\_\_

CIAC contact :

Tel :

e-mail :

<b>Title</b>	The technique of beam drift detection by image electron signal from electron beam scanning
<b>Inventor (s)</b>	Yen, Jia-Yush/Prof., Mechanical Engineering, NTU Chen, Yung-Yaw/Prof., Electrical Engineering, NTU Kuo, Yi-Hung 、Wu, Cheng-Ju/Mechanical Engineering, NTU
<b>Brief Description</b>	The present invention is a sensing technique related to the multiple electron beam drift detection, and mainly combined with an image electron signal detection device and a set of patterns that can be detected easily. The detection device receive the scattered electrons and produce the electron image, and the patterns provide image enhancement. This invention contributes a fast and easy technique to detect multiple electron beam drift.
<b>Fields of Application</b>	Semiconductor manufacturing
<b>Advantages</b>	This technology can be applied to any instruments equip with electron beam, such as electron microscopy. Especially in the application of multiple electron beam direct writing system. Through this technique, we can effectively detect the electron beam drift and further control the electron beam.
<b>Market Potential</b>	This technology can be applied in multi-electron beam direct writing system, it will directly contribute to the related investment.
<b>IP Right(s)</b>	
<b>Picture</b>	